

要 約

本発明は、被加熱物が置かれる環境を制御する手段の導入により、多様な被加熱物を良好な品質を維持しつつ加熱するマイクロ波加熱装置を提供することを目的とする。かかる目的を達成するために、被加熱物を収容する加熱室と、前記被加熱物にマイクロ波を照射するマイクロ波発生手段と、前記加熱室に蒸気を供給する蒸気発生手段と、前記マイクロ波発生手段および前記蒸気発生手段を前記被加熱物の内部温度と表面温度が略一致するように制御する制御手段とを備えた構成を有する。